07;13

## Начальные стадии формирования интерфейса кремний—железо

© М.В. Гомоюнова, Г.С. Гребенюк, К.М. Попов, И.И. Пронин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: Igor.Pronin@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 28 ноября 2012 г.

Методом фотоэлектронной спектроскопии высокого разрешения с использованием синхротронного излучения исследовано формирование интерфейса Si/Fe. Эксперименты проведены *in situ* в условиях сверхвысокого вакуума  $(3\cdot 10^{-10}\,\mathrm{Torr})$  в диапазоне покрытий  $0.04\div 0.45\,\mathrm{nm}$ . Обнаружено, что процесс начинается с формирования на поверхности железа силицида FeSi и твердого раствора Fe—Si. При дальнейшем увеличении покрытия твердый раствор перестраивается в ферромагнитный силицид Fe3Si и немагнитный силицид FeSi. Показано также, что термостимулированные твердофазные реакции, приводящие к перестройке силицидов FeSi и Fe3Si в полупроводниковый силицид  $\beta$ -FeSi2, начинают протекать при температуре, близкой к  $600^{\circ}\mathrm{C}$ .

Взаимодействие атомов Fe с поверхностью кремния исследуется уже более двух десятилетий и процессы формирования интерфейса Fe/Si достаточно подробно изучены [1–4]. В то же время обратная система Si/Fe привлекала гораздо меньше внимания исследователей. Нам известны лишь три публикации [5–7], посвященные начальным стадиям формирования интерфейса Si/Fe. В первой из них показано, что нанесение кремния на поверхность поликристаллического железа сопровождается формированием ряда аморфных фаз  $Fe_xSi_{1-x}$  разного состава, содержание кремния в которых возрастает с ростом покрытия. С другой стороны, согласно данным работы [6], этот интерфейс в

1 1

основном образован моносилицидом железа, толщина которого достигает  $13\,\text{Å}$ . И наконец, в работе [7] показано, что неидентичность межфазовых границ Fe/Si и Si/Fe обусловлена разными механизмами диффузии атомов Fe в этих двух областях. Следует также отметить, что в работах [6,7] магнитные свойства формируемых интерфейсов не изучались. Между тем они очень важны, так как определяют качество многослойных магнитных структур (Fe/Si) $_n$ , представляющих большой интерес для развития спинтроники [8]. Поэтому в данной работе мы попытались восполнить этот пробел и получить в едином эксперименте информацию как о фазовом составе, так и о магнитных свойствах межфазовой границы, образующейся при нанесении кремния на поликристаллическую пленку железа при комнатной температуре и последующем отжиге образца.

Исследования проводились в условиях сверхвысокого вакуума  $(3 \cdot 10^{-10} \, \text{Torr})$ . Кремний наносился на поверхность поликристаллических пленок железа, сформированных на поверхности монокристалла Si(111). Скорость нанесения Si была примерно 0.1 nm/min. Диапазон толщин покрытий составлял  $0.04 \div 0.45\,\mathrm{nm}$ . Основным методом исследования элементного и фазового составов, а также электронного строения формируемой межфазовой границы являлась фотоэлектронная спектроскопия высокого энергетического разрешения ( $\sim 100\,\mathrm{meV}$ ) с использованием синхротронного излучения. Энергия фотонов составляла 135 eV. Изучение магнитных свойств интерфейса проводилось in situ с помощью поверхностно-чувствительного метода, основанного на эффекте магнитного линейного дихроизма в фотоэмиссии 3р-электронов железа [9-11]. Эффект состоит в том, что при регистрации спектров в узком телесном угле вдоль нормали к поверхности образца, являющегося ферромагнетиком, энергетическое положение и форма линии Fe 3p оказываются зависящими от направления намагниченности пленки металла в плоскости поверхности образца. Для намагничивания пленок мы использовали пару катушек Гельмгольца, помещенных внутри вакуумной камеры, которые позволяли создавать магнитное поле напряженностью  $10^3$  Ое. Спектры Fe 3p-электронов измерялись в режиме остаточной намагниченности для двух противоположных направлений магнитного поля. Весь цикл измерений, необходимых для характеризации интерфейса, занимал около 30 min, после чего сразу проводилось очередное напыление кремния. Для получения информации о термической стабильности сформированного интерфейса

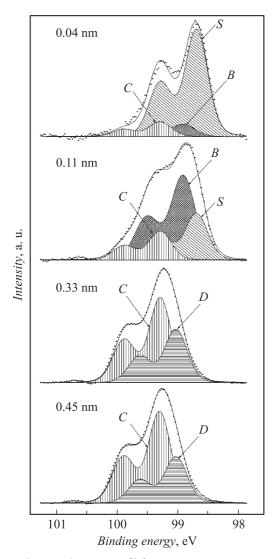
был проведен ряд пятиминутных отжигов образца при возрастающих до  $600^{\circ}\mathrm{C}$  температурах.

Серия типичных спектров Si 2p-электронов, снятых после нанесения возрастающих покрытий кремния на поверхность железа, показана на рис. 1. Спектры приведены с вычтенным фоном. Видно, что уже после напыления  $0.04\,\mathrm{nm}$  Si в фотоэлектронном спектре четко просматривается характерная для кремния дублетная линия Si  $2p_{1/2,3/2}$  со спинорбитальным расщеплением  $0.6\,\mathrm{eV}$ . Энергия связи Si  $2p_{3/2}$  остовных электронов при этом равна  $98.7\,\mathrm{eV}$ . С ростом покрытия положение линии сдвигается в область больших энергий связи электронов. При наибольшем покрытии этот сдвиг составляет  $0.6\,\mathrm{eV}$ .

Сведения о фазовом составе формирующегося интерфейса были получены на основе разложения измеренных спектров Si 2p на составляющие, выполненного с помощью стандартной процедуры, описанной в [12]. Полученные результаты также показаны на рис. 1. Из него видно, что спектр, соответствующий 0.04 nm Si, складывается из трех мод: доминирующей составляющей S, а также мод B и C. Их энергии связи равны соответственно 98.7, 98.92 и 99.30 eV. Сопоставление этих значений с аналогичными данными, полученными для интерфейса Fe/Si [13], показывает, что рассматриваемые моды соответствуют сегрегированному кремнию, твердому раствору кремния в железе и моносилициду FeSi. При увеличении покрытия до 0.11 nm Si мода сегрегированного Si заметно ослабевает, а мода твердого раствора, наоборот, усиливается. Несколько увеличивается и сигнал от моносилицида железа. Образование на начальной стадии формирования интерфейса моносилицида железа и фазы твердого раствора Fe-Si происходит, по-видимому, вследствие диффузии наносимых атомов Si в поверхностные слои пленки железа. Аргументом в пользу этого вывода является отсутствие в спектрах, измеренных для субмонослойных покрытий, аномально узкой ( $\sim 150\,\mathrm{meV}$ ) моды адсорбированных атомов кремния [14]. Это говорит о том, что на поверхности образца остаются лишь двумерные островки сегрегированного кремния. Значительное уменьшение интенсивности сигнала от этих островков в диапазоне покрытий от 0.04 до 0.11 nm показывает, что и из этого состояния атомы Si диффундируют в приповерхностную область образца.

При покрытии  $0.33\,\mathrm{nm}$  Si из спектра исчезают моды твердого раствора и сегрегированного кремния, но усиливается компонента моносилицида железа и появляется новая мода D с энергией свя-

<sup>1\*</sup> Письма в ЖТФ, 2013, том 39, вып. 8

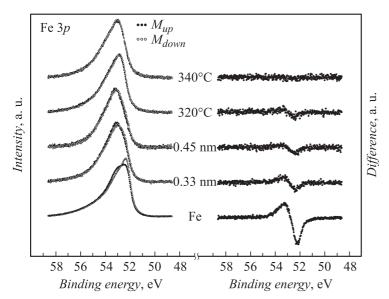


**Рис. 1.** Спектры фотовозбужденных Si 2p-электронов для покрытой кремнием поверхности железа, а также результаты разложения этих спектров на составляющие. Различной штриховкой обозначены моды спектров, соответствующие разным фазам кремния.

зи 99.75 eV. Согласно данным работы [13], ее следует идентифицировать как соответствующую силициду Fe<sub>3</sub>Si. Фазы FeSi и Fe<sub>3</sub>Si наблюдаются и при больших покрытиях (0.45 nm), однако при этом несколько меняется соотношение интенсивностей их мод. Информацию об эффективной толщине слоев силицидов железа, образовавшихся в области интерфейса, можно получить с помощью численного моделирования экспериментальных зависимостей интенсивности соответствующих мод от степени покрытия. В рамках этого моделирования предполагается, что межфазовая граница имеет слоистое строение, и чем выше содержание металла в силициде, тем ближе этот слой примыкает к пленке железа. При этом интенсивность сигнала от каждой фазы полагается экспоненциально затухающей с глубиной. Расчеты, проведенные для наибольшего покрытия (0.45 nm), показали, что эффективные толщины слоев FeSi и Fe<sub>3</sub>Si равны соответственно 0.18 и 1.3 nm.

Рассмотренный процесс формирования интерфейса имеет некоторые общие черты с процессом образования интерфейса в обратной системе (Fe/Si). При нанесении железа на поверхность кремния сначала также формируется сверхтонкий слой моносилицида железа (но со структурой типа CsCl), и на нем тоже растет пленка твердого раствора Fe-Si. При этом в случае интерфейса Fe/Si(100) при покрытии, равном 0.45-0.50 nm, эта пленка перестраивается в силицид  $Fe_3Si$  [4]. Для системы Fe/Si(111) такой трансформации не наблюдалось [15].

Обратимся теперь к результатам исследования магнитных свойств интерфейса. Как указано выше, они изучались методом магнитного линейного дихроизма в эмиссии Fe 3р-электронов. Полученные результаты иллюстрирует рис. 2. В левой его части приведены спектры Fe 3р-электронов, измеренные для исходной пленки железа, а также после нанесения на нее кремния. Они были получены для двух противоположных направлений намагниченности образца ( $M_{up}$ и  $M_{down}$ ). В правой части рисунка для лучшего выявления различий спектров показаны разностные кривые  $(I_{up}-I_{down})$ . Видно, что увеличение степени покрытия приводит к ослаблению эффекта магнитного линейного дихроизма, и, следовательно, остаточная намагниченность анализируемой приповерхностной области уменьшается. Нанесение на поверхность образца 0.45 nm Si снижает эффект примерно в 3 раза. Это обусловлено тем, что из двух силицидов, образующихся на поверхности образца, ферромагнитным является лишь Fe<sub>3</sub>Si, причем его остаточная намагниченность меньше, чем у чистого железа. Кроме того, этот



**Рис. 2.** Спектры Fe 3p-электронов, измеренные для двух противоположных направлений намагниченности чистого и покрытого кремнием образца, а также соответствующие им разностные кривые.

слой экранируется немагнитным силицидом FeSi, что снижает долю фазы Fe<sub>3</sub>Si в измеряемом спектре 3p-электронов железа. При этом вклад от немагнитной фазы становится доминирующим, что приводит к существенному снижению величины эффекта магнитного линейного дихроизма.

Обратимся теперь к результатам, касающимся термостабильности рассматриваемого интерфейса. Отжиг образца до температуры  $500^{\circ}$ С слабо влияет на его фазовый состав. Наблюдается лишь некоторое усиление моды FeSi и, наоборот, ослабление моды Fe<sub>3</sub>Si. Однако дальнейшее повышение температуры до примерно  $600^{\circ}$ С радикально меняет интерфейс. Протекающие в этих условиях термостимулированные реакции приводят к исчезновению мод FeSi и Fe<sub>3</sub>Si и появлению новой компоненты Si 2p-спектра, соответствующей богатому кремнием полупроводниковому силициду железа  $\beta$ -FeSi<sub>2</sub>. Следует отметить, что формирование этого силицида примерно в том же температурном

интервале наблюдалось и при отжиге тонких пленок железа, нанесенных на поверхность монокристаллического кремния [16]. Что касается влияния отжигов на магнитные свойства исследуемого интерфейса, то при температурах вплоть до  $320^{\circ}$ C оно было очень незначительным (рис. 2). В то же время пятиминутный отжиг образца при  $340^{\circ}$ C приводил к практически полному исчезновению ферромагнетизма в приповерхностной области.

Таким образом, в работе обнаружено, что формирование интерфейса Si/Fe происходит в два этапа. На первой стадии образуются фазы моносилицида железа и твердого раствора Fe-Si с сегрегированным кремнием, возникающие вследствие диффузии наносимых атомов Si в поверхностные слои подложки. На втором этапе твердый раствор перестраивается в силициды  $Fe_3Si$  и FeSi. Установлено также, что при формировании интерфейса остаточная намагниченность приповерхностной области существенно уменьшается.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 10-02-00632) и Российско-Германской лаборатории в HZB BESSY.

## Список литературы

- [1] Alvarez J., Hinarejos J.J., Michel E.G. // Phys. Rev. B. 1992. V. 45. P. 14042.
- [2] Bertoncini P., Wetzel P., Berling D. // Phys. Rev. B. 1999. V. 60. P. 11 123.
- [3] Kataoka K., Hattori K., Miyatake Y. // Phys. Rev. B. 2006. V. 74. P. 155 406.
- [4] Gomoyunova M.V., Pronin I.I., Malygin D.E. et al. // Surf. Sci. 2007. V. 601. P. 5069.
- [5] Kläsges R., Carbone C., Eberhardt W. et al. // Phys. Rev. B. 1997. V. 56. P. 10 801.
- [6] Naik S.R., Rai S., Lodha G.S. et al. // J. Appl. Phys. 2006. V. 100. P. 013 514.
- [7] Gupta A., Kumar D., Phatak V. // Phys. Rev. B. 2010. V. 81. P. 155 402.
- [8] Varnakov S.N., Komogortsev S.V., Ovchinnikov S.G. et al. // J. Appl. Phys. 2008.V. 104. P. 094 703.
- [9] Roth Ch., Hillebrecht F.U., Rose H.B. et al. // Phys. Rev. Lett. 1993. V. 70. P. 3479.
- [10] Sirotti F., Rossi G. // Phys. Rev. B. 1994. V. 49. P. 15 682.
- [11] Janke-Gilman N., Hochstasser M., Willis R.F. // Phys. Rev. B. 2004. V. 70. P. 184 439.

- [12] Gomoyunova M.V., Pronin I.I., Malygin D.E. et al. // Surf. Sci. 2006. V. 600. P. 2449.
- [13] Гомоюнова М.В., Пронин И.И. // ЖТФ. 2010. Т. 80. С. 156.
- [14] *Пронин И.И., Гомоюнова М.В., Соловьев С.М.* и др. //  $\Phi$ TT. 2011. T. 53. C. 573.
- [15] Гомоюнова М.В., Малыгин Д.Е., Пронин И.И. // ФТТ. 2008. Т. 50. С. 1518.
- [16] Pronin I.I., Gomoyunova M.V., Malygin D.E. et al. // J. Appl. Phys. 2008. V. 104. P. 104 914.